# ガスアルゴン中の電子比例蛍光の 波形構造と発光機構

### 早稲田大学 修士1年 武田 知将



ICEPPシンポジウム

2019/2/19

2/19





取り出し電場

液面の高さ

### □S2波形

### S2:入射粒子がLArと相互作用して発生した電離電子がGArに取り出されて発光



圧力

LAr

2018/6の論文(@ロシア) 低取り出し電場(高圧力)下において VUV成分(128nm)+UV・NIR(Bremsstrahlung)成分?

# 実験セットアップ & event selection

ICEPPシンポジウム 2019/2/19 **4/19** 



# S2波形解析

観測されたS2波形



波形の違いを理解するには... S2発光過程(1.液相、2.気相)









8/19





9/19



ICEPPシンポジウム 2019/2/19 10/19





高エネルギー反跳事象(@~1MeV)において... S2波形の違いは反跳粒子の反跳方向によるものであると考えられる

## まとめ1

ICEPPシンポジウム 2019/2/19 **11/19** 

### ロまとめ

- S2は検出器のfiducialsationをする上で重要な役割を果たす
- S2波形は電子雲の情報を保存
  - ▶ S2波形の理解→各事象の相互作用の詳細理解
- 高エネルギーER事象のS2波形fitにより
   反跳粒子の反跳方向が波形に現れていることを示した

   ふニネルギーER事象について方向感度あることを示唆

### ロ今後の展望

- S2波形fitのより定量的な評価
- ・ 低エネルギーER事象を使ったLArの拡散定数測定(→Drift方向の位置再構成)
   例) DarkSide-50
   140keVのER事象(rms~0(30µm))を使って、LArの拡散定数の算出

# 低取り出し電場下での S2発光機構

13/19



S2光量の取り出し電場依存性

ICFPPシンポジウム 2019/2/19 14/19

 $Td = 10^{-17} V/cm^2$ 

# 低取り出し電場下でのS2

•

•

•



S2光量のTop Channelの偏り



S2波形の取り出し電場依存性

ICEPPシンポジウム

# S2光量のTop Bottom Asymmetry

ICEPPシンポジウム 2019/2/19 **16/19** 



# S2光量のTop Channel Ratio

ICEPPシンポジウム 2019/2/19

17/19



## まとめ2

ICEPPシンポジウム 2019/2/19 **18/19** 

### ロ まとめ

- 低取り出し電場下において電子比例蛍光とは異なる発光成分が存在する可能性
   ▶ Neutral Bremsstrahlung(NBrS)
- S2波形、S2 Top Bottom Asymmetry、S2 Top Channel Ratioから 低取り出し電場下でNBrS成分が存在することを示唆

### 口今後の展望

- S2詳細Study
  - ✓ 波長スペクトル測定
  - ✓ 放出角度分解能測定
- 現在、GAr setupでのS2 studyを進行中

S2 Gas Setup

ICEPPシンポジウム 2019/2/19

19/19

GArを使ったS2 Study 小型検出器で2相式検出器を<mark>疑似的に再現</mark>





### Back up

## 暗黒物質直接探索実験

ICEPPシンポジウム 2019/2/19 **21/19** 

世界中で暗黒物質直接探索実験が行われている →稀事象探索であるため高感度,背景事象の低減·評価

WIMP直接探索→target原子核との弾性散乱

target原子核のE<sub>Recoil</sub>を検出(光,電離,熱)

WIMP

 $E_{Recoil}$ 

- Nal(DAMA) : 光
- Ge(CoGeNT) : 電離
- CxFy(COUPP): 熱
- Xe(Xenon):光+電離



アルゴン(Ar)

Arと他の希ガスの比較

	Не	Ne	Ar	Kr	Хе
原子量	4	20	40	84	131
蛍光波長(nm)	80	78	128	150	175
大気中の割合(%)	$5 \times 10^{-4}$	$2 \times 10^{-3}$	0.93	$1 \times 10^{-4}$	$9 \times 10^{-6}$

S2**波形**fit

ICEPPシンポジウム 2019/2/19 **23/19** 

$$y(t;\tau_1,\tau_2,\sigma,T',A,t_0,y_0) = y_0 + A \cdot [py'(t;\tau_1,\sigma,T') + (1-p)y'(t;\tau_2,\sigma,T')]$$
  

$$y'(t;\tau,\sigma,T') = \frac{1}{2T'} [y''(t;\tau,\sigma) - y''(t-T';\tau,\sigma)]$$
  

$$y''(t;\tau,\sigma) = \operatorname{erf}\left(\frac{t}{\sqrt{2}\sigma}\right) - \exp\left(-\frac{t}{\tau} + \frac{\sigma^2}{2\tau^2}\right) \cdot \operatorname{erfc}\left(\frac{\sigma^2 - t\tau}{\sqrt{2}\sigma\tau}\right)$$

erf(x) = 
$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$
 : 誤差関数  
eftc(x) = 1 - erf(x) : 相補誤差関数

parameter	name	Fit status
$ au_1$	Fast成分	0.011µs(fix)
$ au_2$	Slow成分	free
σ	Electron cloud diffusion	0.26µs(fix)
T'	電子雲のDrift方向の初期サイズ	free
p	Fast/(Fast+Slow)	0.23(fix)
Α	波高	Light yield(fix)
$t_0$	S2の立ち上がり時間	free
$y_0$	Baseline offset	free



LAr の 拡 散 定 数

24/19



#### d=0.5[cm]より、 **T**=d/v=**0.31~0.45[µs]**

E/N=4.9e-21[V m^2]=4.9[Td] 上の左下のplotから µ=(2~3)e+2[cm^2/V/s] **v**=µE=(1.1~1.6)e+6[cm/s]=**1.1~1.6[cm/µs]** 

p=1.4[atm]、T\_gas=90[K]のとき  $N = 1.1 \times 10^{26} [m^{-3}]$ 

また、 $dV = 4.5kV \rightarrow E_{Gas} = 5.4kV/cm(z = 0.1mm)$ 

### Arを理想気体と仮定すると

 $N = \frac{1}{k_B} \frac{p}{T_{gas}} = 7.243 \times 10^{22} \frac{p}{T_{gas}}$ 

## GAr中での電子Drift速度





GArの移動度: μ(cm<sup>2</sup>/V/s)

# S2波形fitによるLArの拡散定数の算出

ICEPPシンポジウム 2019/2/19 26/19



 $y_{\text{fit}}(t;\tau_1,\tau_2,p,T,\sigma,A,t_0,y_0)$ =  $y_0 + A \cdot y(t-t_0;\tau_1,\tau_2,p,T,\sigma)$  $y'(t;\tau,T,\sigma) = \frac{1}{2T} \left(y''(t;\tau,\sigma) - y''(t-T;\tau,\sigma)\right)$  $y''(t;\tau,\sigma) = \operatorname{erf}\left(\frac{t}{\sqrt{2}\sigma}\right)$  $-e^{-t/\tau}e^{\sigma^2/2\tau^2} \operatorname{erfc}\left(\frac{\sigma^2 - t\tau}{\sqrt{2}\sigma\tau}\right)$ 





TABLE IV: A summary of the diffusion constant values  $D_L$  measured from different data sets and different

			extraction	on neids.	
Drift $[V/cm]$	Extr. $[\rm kV/cm]$	R $[cm]$	$S2 [10^3 PE]$	$D_L \ [\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}]$	$\sigma_0^2 \; [ imes 10^{-2}  \mathrm{mm}^2]$
200	2.8	[0, 3]	[40, 50]	$4.09\pm0.05$	$2.94 \pm 0.10$
200	2.8	[3, 6]	[40, 50]	$4.10\pm0.04$	$2.98 \pm 0.07$
200	2.8	[6, 9]	[40, 50]	$4.10\pm0.04$	$3.07\pm0.06$
200	2.8	[9, 12]	[40, 50]	$4.12\pm0.04$	$3.34 \pm 0.06$
200	2.8	[12, 15]	[40, 50]	$4.19\pm0.04$	$3.45\pm0.06$
200	2.8	[9, 12]	[30, 40]	$4.09\pm0.04$	$3.00 \pm 0.05$
200	2.8	[9, 12]	[20, 30]	$4.00\pm0.04$	$2.81 \pm 0.05$
200	2.8	[9, 12]	[10, 20]	$3.92\pm0.04$	$2.37\pm0.05$
200	2.3	[0, 15]	[10, 50]	$4.16\pm0.04$	$3.76 \pm 0.07$

TABLE V: Diffusion constant  $D_L$  measured under different drift fields.

Drift $[V/cm]$	Extr. [kV/cm]	R [cm]	$S2 [10^3 PE]$	$D_L \ [\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}]$	$\sigma_0^2 \; [ imes 10^{-2}  \mathrm{mm}^2]$
100	2.8	[0, 15]	[10, 50]	$4.35\pm0.05$	$2.67 \pm 0.09$
150	2.8	[0, 15]	[10, 50]	$4.21\pm0.04$	$2.99 \pm 0.05$
200	2.8	[0, 15]	[10, 50]	$4.05\pm0.04$	$2.76\pm0.04$

### S2 pulse shape fit(preliminary)

ICEPPシンポジウム 2019/2/19 **27/19** 





 $\tau 2$ 

tau2\_Bot

ð

Number

Enevts 005

200

100

0

0

2

4

6

8

$$y(t; \tau_1, \tau_2, \sigma, T, A, t_0, y_0)$$
  
=  $y_0 + A \cdot [py'(t; \tau_1, \sigma, T) + (1 - p)y'(t; \tau_2, \sigma, T)]$   
 $\sigma = 0.15[\mu s]$   
 $T, \tau 2, t_0, y_0$ : free



tau2 Bot

Entries

Mean

RMS

10

 $\tau_{slow}$  [µS]

1847

3.414

0.5263



ICEPPシンポジウム 2019/2/19 **28/19** 



ICEPPシンポジウム 2019/2/19 **29/19** 

• S2光量は光量分布の形に注目

S2光量の評価

- 光量分布が基準の分布に合うようにscale
- scale値の逆数をS2光量と定義



実験セットアップ

データ取得

- γ線源(<sup>60</sup>Co)を液面よりも下に固定
- コリメートしたγ線を検出器内に照射 (Drift電場:0.2kV/cm)

#### 圧カ、取り出し電場の測定点

	-					
圧力	Ar	node-	Offse	t間電	<b>፪</b> 圧(k	XV)
(atm)	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
1.10	0	0	0	0	0	
1.40	0	0	0	0	0	0
1.45		0				
1.50		0				
1.55		0				
1.60		0				
	F	カと	·液ī	面の	高さ	オが
	/					_ /0





## S2光量の補正

ICEPPシンポジウム 2019/2/19 **31/19** 

液面の高さ依存性



電子比例蛍光モデル

S2光量: 
$$LY = LY(p, \mathbf{z}_l, E(z_l))$$

### 補正方法

S2光量vs圧力vs液面の高さの3Dplotに対して S2光量関数をfit

S2光量関数  $LY = (AE(z_l + z_{l0}) + Bp)(D/2 - (z_l + z_{l0}))$ free parameter:*A*, *B*, *z*<sub>l0</sub>

以下、液面・圧力・電場依存性を見ていくが 他2つのparameterは変化なしor一定になるよう補正

# S2光量の補正

S2光量の各種環境依存性を見るため、 圧力、液面の高さを変数に持つ関数で補正を行う

電子比例蛍光モデル S2光量:*LY = LY(p,z<sub>l</sub>,E(z<sub>l</sub>)*)

$$LY = (AE(z_l + z_{l0}) + Bp)(D/2 - (z_l + z_{l0}))$$

free parameter: A, B,  $z_{l0}$ 





ICEPPシンポジウム 2019/2/19 **32/19** 

### 補正方法

- 1. S2光量の関数を3Dplot(S2光量vs圧力vs液面)にfitし free parameterを決定
- 2. S2光量の関数を用いて各点における補正係数を決定
- 3. 補正係数を各点にかける

	free parameter	値							
	$A ({\rm kV^{-1}})$	$2.37 \pm 0.21$							
	B (bar <sup>-1</sup> · cm <sup>-1</sup> )	$-2.54 \pm 0.28$							
	<i>z<sub>l</sub></i> 0 (cm)	$-(5.5\pm4.6) imes10^{-2}$							
液面	i計が0(mm)の#	青度で取り出し電極の中	□線(						
取り	取り付けられていることを示唆								

ICEPPシンポジウム 2019/2/19 33/19





A.Bonder et al., "Two-phase argon and xenon avalanche detectors based on Gas Electron Multipliers", 2005.

データ取得

ICEPPシンポジウム 2019/2/19 **34/19** 



Run17.1 Run17.3

ICEPPシンポジウム 2019/2/19 **35/19** 

run150(Run17.3) DriftTimecut:40~70us Energycut:1500~3000(p.e.)



run150(Run17.3) run530(Run17.1)

### run530(Run17.1) DriftTimecut:75~105us Energycut:2500~5000(p.e.)



S2/S1(mean+-meanerror) 5.94462e+-1.86072e-02 5.80494e+-1.79967e-02 NBrS 理論

ICEPPシンポジウム 2019/2/19 **36/19** 



 $p = 1.000 \pm 0.005 atm, T = 87.3K$ PMT w/ TPB : 3, PMT w/o TPB : 1, SiPM : 1

NBrS論文1





PMT w/o TPB : 300-650nm PMT w/ TPB : 100-650nm SiPM : 400-1000nm

2019/2/19

ICEPPシンポジウム

38/19



NBrS論文2





ICEPPシンポジウム 2019/2/19 **39/19** 

#### PMT w/ TPB - PMT w/o TPB



NBrS論文3

### Cut parameter

pedestal RMS cut : pedr[ich]<=5.0[us] (for all channel) negative charge cut : N<=100.0[p.e.] detected time cut : -0.5<=Min(detected\_time[ich])[us]<=-0.1 S2dtr cut : run dependent DriftTime cut : 40<S2dtv[us]<70 (Top+BottomのS2dtvの光量重心をとったもの) Energy cut : 1500<S1tot[p.e.]<3000 (Compton edge) S2 Center cut : S2(Ch1)[p.e.]==S2(TopMax)[p.e.]

	run193								
run150 2.0<=S2dtr<=9.0	cut name	cut(#)	cut(%)c	ut step(%)	thiscut(#	)thiscut(%)	N-1cut(	#) N-1cut(	%)
run188 2.0<=S2dtr<=10.0	pedr cut	80000 78643	- 98.304	 1.6962	- 78643	 98.304	0	0	
run189 2 0<=S2dtr<=14 0	n-charge cut	78080	97.6	0.70375	78218	97.772	0	0	
	detected_time_cu	t 7671 42618	9 95.89	9 1.7012 12 626	2 7746 13573	54 96.83	0	0	
run190 2.0<=S20tr<=15.0	DriftTime cut	25801	32.251	21.020	42598	53.248	0	0	
run191 2.0<=S2dtr<=18.0	S1tot cut	14796	18.495	13.756	36623	45.779	0	0	
	S2 Center cut	1924	2.405	16.09	10686	13.357	0	0	
run198 2.0<=S2dtr<=9.0									

run198 2.0<=S2dtr<=9.0 run197 2.0<=S2dtr<=9.0 run193 2.0<=S2dtr<=9.0 run192 2.0<=S2dtr<=9.0 S2dtr

ICEPPシンポジウム 2019/2/19 **41/19** 



S1tot [p.e.]



S1tot [p.e.]





S1tot [p.e.]

Cut

ICEPPシンポジウム 2019/2/19 **42/19** 

#### run197



Cut

ICEPPシンポジウム 2019/2/19

43/19



cut name	cut(#)	cut(%)cເ	ut step(%)	thiscut(#	)thiscut(%)	N-1cut(;	#) N-1cu	it(°
No Cut	80000	-		-				
pedr cut	79673	99.591	0.40875	79673	99.591	0	0	
n-charge cut	79270	99.087	0.50375	79325	99.156	0	0	
detected_time cut	t 7894	1 98.67	6 0.4112	5 7956	54 99.455	0	0	
S2 RMS cut	35566	44.458	54.219	35933	44.916	0	0	
DriftTime cut	23393	29.241	15.216	42934	53.668	0	0	
S1tot cut	14737	18.421	10.82	40068	50.085	0	0	
S2 Center cut	2070	2.5875	15.834	11516	14.395	0	0	

Cut



cut name	CUT(#)	CUT( %)CL	it step(%)	)thiscut(#	)thiscut(%	) N-ICU	C(#) IN-1	CUT( %)
No Cut	80000	-		-	-	-		
pedr cut	79792	99.74	0.26	79792 9	99.74	0	0	
n-charge cut	79457	99.321	0.41875	79525	99.406	0	0	
detected_time cut	t 7917	7 98.97	1 0.35	79682	99.603	0	0	
S2 RMS cut	35061	43.826	55.145	35347	44.184	0	0	
DriftTime cut	23730	29.663	14.164	42979	53.724	0	0	
S1tot cut	15990	19.988	9.675	41104	51.38	0	0	
S2 Center cut	2464	3.08	16.907	11931	14.914	0	0	

S2平均波形

ICEPPシンポジウム 2019/2/19 **45/19** 





NBrSの利用

ICEPPシンポジウム 2019/2/19 **46/19** 



問題点

- S2の発光領域が拡大→S2によるxy位置分解能の悪化
   ▶ 壁面にMPPCを並べる
- S2波形によるz方向位置分解能の悪化
   ▶ 液相領域を電場方向に伸ばす
- Grid2で電離電子が吸収されてしまう

### 反跳電子のtrack長(by Geant4 simulation)

2019/2/19 47/19

ICEPPシンポジウム

Geometry ٠ World :  $1.5 \times 1.5 \times 1.5$  m, air Chamber :  $\phi 0.3 \text{ m}$ , H1.0 m, LAr

- Set up of Geant4 ۲
  - Physics list : FTFP\_BERT
  - ✓ setCut : 1.0um

Center of the step

0.02

-3

-2

0

1

✓ ~1.1, 1.3MeV γray



### Excitation $Ar + E_{recoil} \rightarrow Ar^*$ $Ar^* + 2Ar$ $\rightarrow Ar_2^*(\ {}^{1}\Sigma_u^+ \text{ or }\ {}^{3}\Sigma_u^+) + Ar$ $Ar_2^* \rightarrow 2Ar + hv(128nm)$

### Ionization $Ar + E_{recoil} \rightarrow Ar^{+} + e^{-}$ $Ar^{+} + Ar \rightarrow Ar_{2}^{+}$ $Ar_{2}^{+} + e^{-} \rightarrow Ar^{**} + Ar$ $Ar^{**} \rightarrow Ar^{*} + E_{heat}$ $Ar^{*} + 2Ar \rightarrow Ar_{2}^{*}(\ {}^{1}\Sigma_{u}^{+} \text{ or }\ {}^{3}\Sigma_{u}^{+}) + Ar$ $Ar_{2}^{*} \rightarrow 2Ar + hv(128nm)$